日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

09. 4. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application: 2003年 4月11日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-107885

[ST. 10/C]:

[JP2003-107885]

5]

RECD 0 3 JUN 2004

WIPO PCT

出 願 人
Applicant(s):

独立行政法人理化学研究所

有限会社パックス

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 5月20日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

PAC001

【提出日】

平成15年 4月11日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

GO1N 21/00

G01J 1/08

G02B 7/00

【発明の名称】

テラヘルツ波透過用光学部品、テラヘルツ波光学系、テ

ラヘルツ帯波処理装置および同方法

【請求項の数】

12

【発明者】

【住所又は居所】

宮城県仙台市荒巻字青葉 519-1399 理化学研

究所フォトダイナミックス研究センター内

【氏名】

南出 泰亜

【発明者】

【住所又は居所】 宮城県仙台市荒巻字青葉 519-1399 理化学研

究所フォトダイナミックス研究センター内

【氏名】

伊藤 弘昌

【発明者】

宮城県仙台市青葉区南吉成六丁目6番地の3 有限会社 【住所又は居所】

パックス内

【氏名】

工藤 朗人

【特許出願人】

【持分】

072/100

【識別番号】

000006792

【氏名又は名称】 理化学研究所

【特許出願人】

【持分】

028/100

【住所又は居所】

宮城県仙台市青葉区南吉成六丁目6番地の3

【氏名又は名称】

有限会社パックス

【代表者】

工藤 朗人

【代理人】

【識別番号】

100088096

【弁理士】

【氏名又は名称】

福森 久夫

【電話番号】

03-3261-0690

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

007467

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【物件名】

図面 1

要

【プルーフの要否】

【書類名】

明細書

【発明の名称】 テラヘルツ波透過用光学部品、テラヘルツ波光学系、テラヘルツ帯波処理装置および同方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 シクロオレフィンからなることを特徴とするテラヘルツ波透 過用光学部品。

【請求項2】前記光学部品は、レンズ、プリズム、ビームサプライヤー、ビームスプリッター、ファイバー、導波路、ミラー、ポラライザー、ウィンドウのいずれかであることを特徴とする請求項1記載のテラヘルツ波透過用光学部品。

【請求項3】 テラヘルツ波発生源と、該テラヘルツ発生源から発生したテラヘルツ波の光軸上に配置されたシクロオレフィンからなる光学部品とを有することを特徴とするテラヘルツ波光学系。

【請求項4】 可視光源を設け、該可視光源からの可視光が前記テラヘルツ波の光軸上に乗るようにしたことを特徴とする請求項3記載のテラヘルツ波光学系。

【請求項5】 前記テラヘルツ波の周波数は100GHz~10THzであることを特徴とする請求項3又は4記載のテラヘルツ波光学系。

【請求項6】 所定のテラヘルツ波を発生するテラヘルツ波発生装置と、 前記テラヘルツ波を検出するテラヘルツ波検出器と、

前記テラヘルツ波発生装置と前記テラヘルツ波検出器との間の光透過路を定めて光軸を規制する第1の光透過規制器と、

前記第1の光透過規制器と前記テラヘルツ波検出器との間の前記光軸上のテラヘルツ波を透過させ、且つ所定の入射角度を有して入射される光を反射させる光半透過板と、

前記光半透過板と前記テラヘルツ波検出器との間の前記光軸上に設定された第 2の光透過規制器とを有して構成され、

所定の可視光をパイロット光として前記光半透過板へ入射され該光半透過板により反射させ、該反射させた可視光の光軸を前記テラヘルツ波の光軸へ重畳させ、該テラヘルツ波の光軸を前記可視光により模擬的に目視可能としたことを特徴

とするテラヘルツ帯波処理装置。

【請求項7】 前記テラヘルツ波検出器は、Siボロメーターであることを特徴とする請求項6記載のテラヘルツ帯波処理装置。

【請求項8】 前記光半透過板へ入射される前記パイロット光の光軸調整用 として、少なくとも1個のパイロット光導入ミラーを、さらに有したことを特徴 とする請求項6または7記載のテラヘルツ帯波処理装置。

【請求項9】 前記パイロット光として、可視光レーザを用いたことを特徴とする請求項6から8の何れかに記載のテラヘルツ帯波処理装置。

【請求項10】 前記光透過規制器にアパーチャーを、前記光半透過板にシクロオレフィン板を、それぞれ適用したことを特徴とする請求項6から9の何れかに記載のテラヘルツ帯波処理装置。

【請求項11】 可視光をパイロット光としてテラヘルツ帯波を処理することを特徴とするテラヘルツ帯波処理方法

【請求項12】 所定のテラヘルツ波を検出する検出器の位置と方向を該テラヘルツ波の進行向きに合わせる検出器位置調整工程と、

前記検出器の測定値が下がらない位置に少なくとも1個のアパーチャーをセットするアパーチャーセット工程と、

パイロット光導入ミラーを用いて所定のパイロット光を前記アパーチャーへ通 させ、該パイロット光の光軸と前記テラヘルツ波の光軸とを同軸に重ねるパイロット光軸調整工程とを有して構成され、

所定の可視光をパイロット光として該可視光の光軸を前記テラヘルツ波の光軸へ重畳させ、該テラヘルツ波の光軸を前記可視光により模擬的に目視可能としたことを特徴とするテラヘルツ帯波処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、テラヘルツ波用光学部品、テラヘルツ波光学系、テラヘルツ帯波処 理装置および同方法に関し、たとえば、テラヘルツ光をより容易により有効に活 用可能とするテラヘルツ波用光学部品、テラヘルツ帯波処理装置および同方法に 関する。

[0002]

【発明の背景】

【特許文献1】

特開2002-303574号公報

【特許文献2】

特開2002-246664号公報

【特許文献3】

特開2002-223017号公報

従来、テラヘルツ帯電磁波は、通常状態において不可視光である。この様なテラヘルツ帯光は、波長 $3\,\mathrm{mm}\sim30\,\mu\,\mathrm{m}$ 、周波数 $1\,0\,0\,\mathrm{GHz}\sim10\,\mathrm{THz}$ のゾーンに存在する電磁波であり、物質の測定、検査、イメージ化及びその他の種々の分野において利用されている。

[0003]

上述の通り、テラヘルツ光は人間の目で直接的に見ることはできない。図5は、超長波(VLF)からγ線に至る波長の周波数分布を示している。この周波数帯域において、目に見える光(可視光線)は、赤外線と紫外線とに挟まれた極狭い周波数帯域の波長光であることが知れる。

[0004]

図5からテラヘルツ電磁波は、ミリ波 (EHF) から遠赤外線とに挟まれた波長領域にあり、不可視光線であることが知れる。このテラヘルツ電磁波は、特に近年、実用化が進んでおり、テラヘルツ光の光軸を観察し調整し得る簡単な観察ツールの出現が要望されている。これらの要望に基き、観察ツールとして以下の技術が提案されている。

特許文献1において、テラヘルツ光学系のアライメントの調整は、ダイポールアンテナ等のテラヘルツ光源をピンホール等に置き換え、ピンホールに可視光又は近赤外光(多くの場合、ポンプ光そのもの)を通し、その透過光の様子を観察しながら行われている。即ち、ピンホールの透過光の光路がテラヘルツ光の光路と同一であると見なすことにより行われている。

[0005]

なお、可視光の場合は、その照射位置等を肉眼で直接的に観察することが可能である。近赤外光等の場合は、近赤外光に感応して可視光を発光する材料をシート部材に塗布したカード式赤外センサ(例えば、シグマ光機株式会社から市販されている「SIRC-(1)」(商品名))等の簡便な観察ツールを用いることにより、容易に観察することができる。

[0006]

特許文献 2の技術は、テラヘルツ信号系と固有ジョセフソン接合位置とを確実に結合させることができる単結晶固有ジョセフソン接合テラヘルツ検出器である。その構成は、単結晶固有ジョセフソン接合テラヘルツ検出器であって、基板とこの基板上に搭載される両面加工プロセスで作製された全超伝導Bi 2Sr 2Cu 2O8単結晶固有のジョセブソン接合装置と、このジョセフソン接合装置に集積化されるアンテナを具備するものである。

[0007]

特許文献3には、テラヘルツ光素子と、該テラヘルツ光素子の所定個所に基材と反対側からフェムト秒パルス光を照射する照射部と、2つの導電膜間に流れる電流を検出する電流検出部とを備えたテラヘルツ光検出装置が開示されている。

[0008]

テラヘルツ光素子は、基材と、この基材の平面上に形成された光伝導膜と、光 伝導膜上に形成された互いに分離された2つの導電膜とを備える。導電膜の一部 同士が、基材の平面に沿った方向に所定間隔dを開けるように配置される。基材 は、基材から光伝導膜と反対側へ出射するか、あるいは基材に光伝導膜と反対側 から入射するテラヘルツ光に対してレンズ作用を為すように形成される。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、テラヘルツ帯の電磁波は、可視光領域の光線と比較して減衰率が高い。本特性は、図4からも知れる。図4において、グラフ(b)は、従来の板厚2mmのポリエチレンヘテラヘルツ帯の電磁波を透過させた場合の波長(THz)に対する減衰率特性を示している。本グラフ(b)から、周波数が高くな

るに従い急峻に透過特性が低下することが知れる。また、テラヘルツ帯は、不可 視光であり、その取り扱いが可視光と比較して困難である問題点を有する。

[0010]

また、開示された上記従来技術において、特許文献1では、テラヘルツ光源を ピンホールと同じ位置に正確に置き換えることは非常に困難である。このため、 ピンホールの透過光を基準にしてテラヘルツ光学系のアライメントを調整した後 に、ピンホールをテラヘルツ光源に置き換えるだけでは、そのアライメントを正 確に調整することはできない。

[0011]

そのため本テラヘルツ光学系のアライメントを調整する従来の調整方法では、実際には、ピンホールの光源に置き換えた後にテラヘルツ光の検出信号の強度を測定しつつその強度が高まるように、テラヘルツ光学系のアライメントを再調整して最適化している。 この最適化の作業には、テラヘルツ光の検出信号の強度を頼りにテラヘルツ光学系のアライメントを少しずつ変えていく、試行錯誤の繰り返しが不可欠である。よって、本従来の調整方法では、テラヘルツ光学系のアライメントを正確に行うためには、前述した試行錯誤の繰り返しが必要である。このため、著しく手数を要する問題点を伴う。

[0012]

特許文献2の技術においては、超伝導材料を用いる必要があり、コストが高く、また、製造が困難である問題点を有する。

[0013]

特許文献3の技術は、その製造が複雑である問題点を有する。

[0014]

また、一般的にテラヘルツ波の確認には、液体ヘリウムを用いたボロメータが知られている。しかし、この技術は、大掛かりな測定系が必要になる問題点を有する。

[0015]

本発明は、コストが低く、また、製造が簡単なテラヘルツ波用光学部品、テラ ヘルツ帯波処理装置および同方法を提供することを目的とする。

. [0016]

【課題を解決するための手段】

本発明のテラヘルツ波透過用光学部品は、シクロオレフィンからなることを特 徴とする。

前記光学部品は、レンズ、プリズム、ビームサプライヤー、ビームスプリッター、ファイバー、導波路、ミラー、ポラライザー、ウィンドウのいずれかであることを特徴とする。

本発明のテラヘルツ光学系は、テラヘルツ波発生源と、該テラヘルツ発生源から発生したテラヘルツ波の光軸上に配置されたシクロオレフィンからなる光学部 品とを有することを特徴とする。

[0017]

本発明はのテラヘルツ帯波処理装置は、所定のテラヘルツ波を発生するテラヘルツ波発生装置と、テラヘルツ波を検出するテラヘルツ波検出器と、テラヘルツ波検出器との間の光透過路を定めて光軸を規制する第1の光透過規制器と、第1の光透過規制器とテラヘルツ波検出器との間の光軸上のテラヘルツ波を透過させ、且つ所定の入射角度を有して入射される光を反射させる光半透過板と、光半透過板とテラヘルツ波検出器との間の光軸上に設定された第2の光透過規制器とを有して構成され、所定の可視光をパイロット光として光半透過板へ入射され該光半透過板により反射させ、該反射させた可視光の光軸をテラヘルツ波の光軸へ重畳させ、該テラヘルツ波の光軸を可視光により模擬的に目視可能としたことを特徴としている。

[0018]

また、上記のテラヘルツ波検出器をSiボロメーターとし、光半透過板へ入射されるパイロット光の光軸調整用として少なくとも1個のパイロット光導入ミラーをさらに有し、パイロット光として可視光レーザを用い、光透過規制器にアパーチャーを、光半透過板にシクロオレフィン板を、それぞれ適用するとよい。

[0019]

本発明のテラヘルツ帯波処理方法は、所定のテラヘルツ波を検出する検出器の 位置と方向を該テラヘルツ波の進行向きに合わせる検出器位置調整工程と、 検 出器の測定値が下がらない位置に少なくとも1個のアパーチャーをセットするアパーチャーセット工程と、パイロット光導入ミラーを用いて所定のパイロット光をアパーチャーへ通させ、該パイロット光の光軸とテラヘルツ波の光軸とを同軸に重ねるパイロット光軸調整工程とを有して構成され、所定の可視光をパイロット光として該可視光の光軸をテラヘルツ波の光軸へ重畳させ、該テラヘルツ波の光軸を可視光により模擬的に目視可能としたことを特徴とする。

【作用】

以下に本発明の作用を本発明をなすに際して得た知見とともに説明する。

従来、シクロオレフィンは光学系部品の材料として用いられていた。しかるに、本発明者は、シクロオレフィンからなる光学部品の特性をより詳細に調べたと ころ、該部品は、テラヘルツ波に対して優れた透過特性を有していることを見出 した。

のみならず、該部品は可視光に対しても優れた透過性を有していることをも見出した。さらに、可視光に対するとテラヘルツ光とに対する屈折率の差が0.01以下であるという事項をも見出した。そのため、両者の波長が非常に離れているにもかかわらず、屈折率の差が非常に小さいのでレンズなどの光学部品を通した場合でも同じ場所で集光されるため可視光をパイロット光として使用することができる。結局、例えば、テラヘルツ波の光軸と可視光の光軸とを絶えず一致させてやれば可視光を見ることによりテラヘルツ波の光軸を知ることが可能となる

本発明は上記のようにシクロオレフィンからなる光学部品の新たな特性を発見することによりその用途の拡大を図ったものである。

ここで、シクロオレフィンとしては、高分子体が好適に用いられる。重合体(シクロオレフィンポリマー)あるいは共重合体(シクロオレフィンコポリマー)が好適に用いられる。シクロオレフィンポリマーは商品名ゼオネックス(登録商標)、シクロオレフィンコポリマーは商品名アペル(三井化学株式会社製)として入手可能である。

[0020]

【発明の実施の形態】

次に、添付図面を参照して本発明によるテラヘルツ波用光学部品、テラヘルツ 帯波処理装置および同方法の実施の形態を詳細に説明する。図1から図4を参照 すると、本発明のテラヘルツ波用光学部品、テラヘルツ帯波処理装置および同方 法の一実施形態が示されている。

図1から図3は、テラヘルツ波の同軸にパイロットビーム(可視光)を重ねる 処理手順例を示している。実施形態の処理手順は、図1~図3に示すステップ1 ~ステップ3の対応処理を基に構成される。本アライメント手順例を以下に示す

[0021]

(ステップ1)

図1は、ステップ1が適用されるテラヘルツ波用光学部品、テラヘルツ帯波処理装置および同方法の構成例を示すシステム図である。本図1において、ステップ1が適用されるテラヘルツ波用光学部品、テラヘルツ帯波処理装置および同方法は、パラメトリック発振器型のテラヘルツ波発生装置10、アパーチャー3、シクロオレフィン板4、Siボロメーター(検出器)5を有して構成される。テラヘルツ波発生装置10からは、テラヘルツ波11が出力される。この出力されるテラヘルツ波11の光軸にアパーチャー1の透過光軸を設定する。シクロオレフィン板4を、板前後においてテラヘルツ波11を透過状態に設定する。さらに、Siボロメーター5の位置と方向を、テラヘルツ波の光軸に対し垂直方向に合わせる。

[0022]

(ステップ2)

図2は、テラヘルツ波の同軸にパイロットビーム(可視光)12を重ねる第2の処理手順例を示した図であり、ステップ2が適用されるテラヘルツ波用光学部品、テラヘルツ帯波処理装置および同方法の構成例を示すシステム図である。本図2では、図1の示すステップ1が適用されるテラヘルツ波用光学部品、テラヘルツ帯波処理装置および同方法に加え、さらに、アパーチャー2とアパーチャー3とが追加される。本ステップ2では、シクロオレフィン板4とSiボロメーター5との間に、新たに、アパーチャー2とアパーチャー3とを追加設定する。こ

の追加設定において、Siボロメーター5のテラヘルツ波信号の検出測定値が下がらない位置に、アパーチャー2とアパーチャー3を設定する。本設定では、追加されるアパーチャー2とアパーチャー3の透過孔の光軸を、テラヘルツ波11の光軸に一致させることが要件とされる。

[0023]

(ステップ3)

図3は、第3の処理手順例を示し、ステップ3が適用されるテラヘルツ波用光学部品、テラヘルツ帯波処理装置および同方法の構成例を示すシステム図である。本図3では、図2の示すステップ2が適用されるテラヘルツ波用光学部品、テラヘルツ帯波処理装置および同方法に加え、さらに、パイロット光導入ミラー21とパイロット光導入ミラー22とが追加設定される。本ステップ3では、これらのパイロット光導入ミラー21とパイロット光導入ミラー22との追加処理後に、例えば、可視光レーザのパイロット光12をテラヘルツ波11へ重畳させる

[0024]

パイロット光導入ミラー21とパイロット光導入ミラー22とを追加し、可視 光レーザのパイロット光12を、パイロット光導入ミラー21とパイロット光導 入ミラー22の設定角度調整により、テラヘルツ波11の同軸上へ重畳させる。 本処理において、シクロオレフィン板4へのテラヘルツ波11の軸上へ、パイロット光12の光軸が重畳するようにパイロット光導入ミラー21とパイロット光 導入ミラー22の設定位置、設定角度等を調整する。この位置設定および角度調整により、テラヘルツ波11の光軸上へパイロット光12の光軸を重畳させる。

[0025]

パイロット光12の光軸調整は、Siボロメーター5の出力信号を確認しながらの他に、可視光であるため黙視で確認しながらの調整も可能である。本調整により、パイロット光12の光軸とテラヘルツ光11の光軸とを、同一軸とすることができる。パイロット光12とテラヘルツ光11とを同軸に重ねた後のテラヘルツ光の光軸は、模擬的・擬似的に可視状態となる。

[0026]

上記構成のテラヘルツ波用光学部品、テラヘルツ帯波処理装置および同方法の実施の形態において、シクロオレフィン板4として、テラヘルツ光11に対して減衰特性をより小さくし、パイロット光12に対して反射特性をより高くする必要がある。このシクロオレフィン板4の具体例として、高機能樹脂(商品名; ZEONEX/日本ゼオン(株))がある。図4は、この商品名;ゼオネックス(ZEONEX)とポリエチレンとを比較した、光透過率の特性例を示している。

[0027]

図4において、横軸を周波数 [THz/テラヘルツ]、縦軸を透過率 [Transmittance] としている。図4中の二つのグラフにおいて、上方の(a)がゼオネックス、下方の(b)がポリエチレンのそれぞれの特性グラフである。本図4によれば、ゼオネックスの方が透過特性に優れていることが知れる。なお、両測定には、同一厚の試験試料を用いている。

[0028]

高機能樹脂のシクロオレフィン板4としての適用において、テラヘルツ波用のARコート(無反射コート)材料に使用が可能と判定される。テラヘルツ用各種オプティクス光学面に、波長に応じた厚さを形成することにより、反射を減らすことができる。高機能樹脂の各種の適用例を以下に列挙する。

[0029]

(テラヘルツ波用の各種レンズ材料)

平凸、凸凸、凹、ロッド、シリンドリカル、等光学で用いる各種レンズと同じ 形態のレンズをテラヘルツ用に作ることができる。且つ、可視光とテラヘルツ波 に対して同時にシクロオレフィン板4としての機能を満たすことができる。

[0030]

(テラヘルツ用の各種プリズム用材料)

45° 直角、ダハ、ダブ、等光学で用いる各種レンズと同じ形態のレンズをテラヘルツ用に作ることができる。且つ、可視光とテラヘルツ波に対して同時にシクロオレフィン板4としての機能を満たすことができる。

[0031]

(テラヘルツ波用のビームサプライヤー、ビームスプリッターへ適用)

板状に加工して、一つのテラヘルツ波を表面反射波と透過波に分ける、ビームサプライヤーやビームスプリッターを作ることができる。且つ、可視光とテラヘルツ波に対して、同時にシクロオレフィン板4としての機能を満たすことができる。

[0032]

(テラヘルツ波用のファイバー材料)

ファイバーにすることにより、空気中を伝搬することに不利なテラヘルツ波を 、容易にハンドリングできる。且つ、可視光とテラヘルツ波に対して、同時にシ クロオレフィン板4としての機能を満たすことができる。

[0033]

(テラヘルツ波用の導波路材料)

導波路形状にすることにより、空気中を伝搬することに不利なテラヘルツ波を 高効率に伝播させることができる。且つ、可視光とテラヘルツ波に対して、同時 にシクロオレフィン板4としての機能を満たすことができる。

[0034]

(テラヘルツ波用の実験に用いる)

テラヘルツ波の高透過性を用いることにより、プレパラート(板状)、サンプル (柱状) 入れ等に加工し、試料を載せたり入れたりし、分光等の実験に用いることができる。且つ、可視光とテラヘルツ波に対して同時にシクロオレフィン板4としての機能を満たすことができる。

[0035]

(テラヘルツ波用のミラー材料その1)

テラヘルツ波を透過する特性を生かし、ダイクロイックミラーの基板材料となる。

[0036]

(テラヘルツ波用のミラー材料その2)

テラヘルツ波を透過する特性を生かし、表面又は内部に線状の金属を存在させることにより、高精度で高効率なテラヘルツ波用ハーフミラーを作ることができる。

[0037]

(テラヘルツ波用のポラライザー)

テラヘルツ波を透過する特性を生かし、表面又は内部に線状の金属を存在させることにより、高精度で高効率なテラヘルツ波用ポラライザーを作ることができる。

[0038]

(テラヘルツ波用のウィンドウ材料)

テラヘルツ波を透過する特性を生かし、テラヘルツ波装置のウィンドウ材料となる。且つ、可視光とテラヘルツ波に対して同時に本機能を満たすことが出きる。又、テラヘルツ波に対してブリュースター角に、ウィンドウを配置することにより、本材料の持っている透過率に限りなく近い値で、テラヘルツ波を透過させることができる。

[0039]

(シリコン等の低屈折率分散半導体材料の代替え材料)

テラヘルツ帯において、低屈折分散材料として一般的に使用されているシリコン、ゲルマニューム、ガリュームヒ素、等の半導体は、可視光と共に用いると可視光を吸収して、テラヘルツ波の透過率を減少させる。例として、テラヘルツ波と可視光を、同時に照射している実験系やテラヘルツ波発生装置の上記半導体部と置き換えることにより、高効率化が図れる。

[0040]

なお、上述の実施形態は本発明の好適な実施の一例である。ただし、これに限 定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変形実施 が可能である。

多様化の構成例およびそれに付随する効果例を以下に列挙する。

図6にシクロオレフィンとして、三井化学株式会社製の商品名アペルを用いて テラヘルツ波の透過試験を行った結果を示す。なお、該試験は、厚さ3.5 mm のレンズを用い、入射角0度で行った。本例のおいても良好な透過率が得られた

なお、本発明のおける光学部品の厚さは特に限定されない。また、テラヘルツ

波の入射角も特に限定されず広い範囲で有効である。

[0041]

【発明の効果】

以上の説明より明らかなように、本発明のテラヘルツ帯波処理装置は、所定の テラヘルツ波を発生し、この発生されたテラヘルツ波の進行方向の前面に高機能 樹脂により構成されたオプティクス光学面を設けられて構成している。本構成に より、テラヘルツ帯波の透過特性に優れた装置を構成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明のテラヘルツ波用光学部品、テラヘルツ帯波処理装置および同方法の実 施形態が適用される、第1の処理手順例を示している。

【図2】

ステップ2が適用されるテラヘルツ帯波処理装置の構成例を示すシステム図で ある。

[図3]

ステップ3が適用されるテラヘルツ帯波処理装置の構成例を示すシステム図で ある。

[図4]

シクロオレフィンポリマーとポリエチレンとを比較した、光透過率の特性例を 示したグラフである。

【図5】

超長波 (VLF) からγ線に至る波長の周波数分布を示している。

【図6】

シクロオレフィンコポリマーの場合における光透過率を示したグラフである。

【符号の説明】

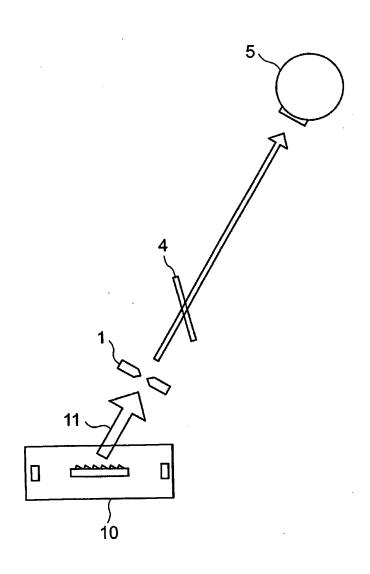
- 1、2、3 アパーチャー
- 4 シクロオレフィン板
- 5 Siボロメーター (検出器)
- 10 テラヘルツ波発生装置

- 11 テラヘルツ波
- 12 パイロット光
- 21、22 パイロット光導入ミラー

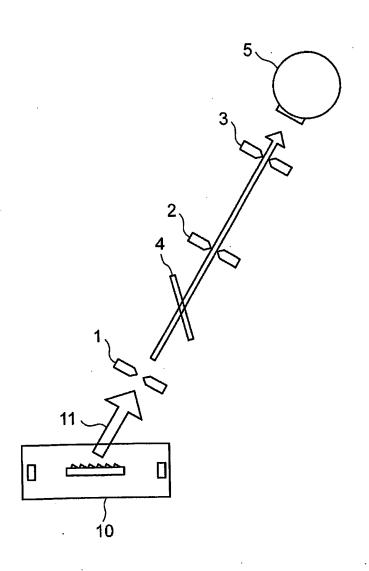
【書類名】

図面

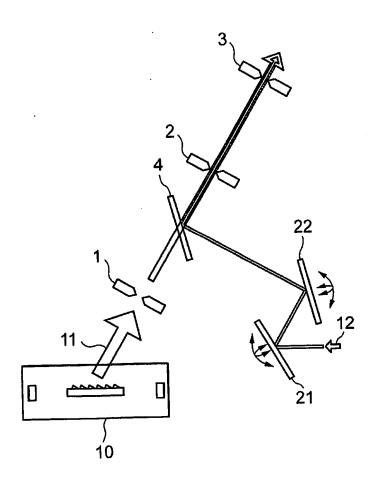
【図1】



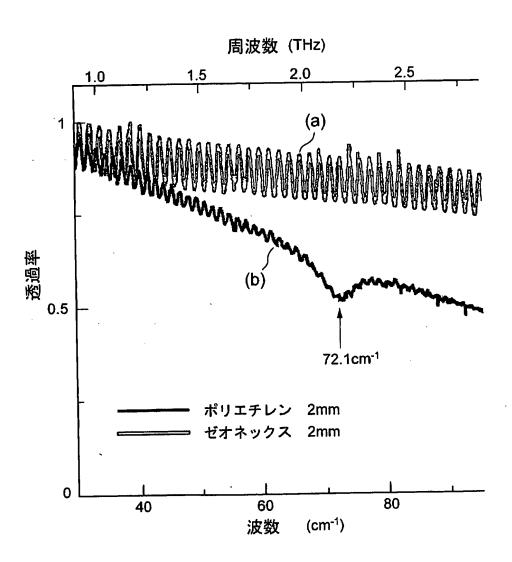
【図2】



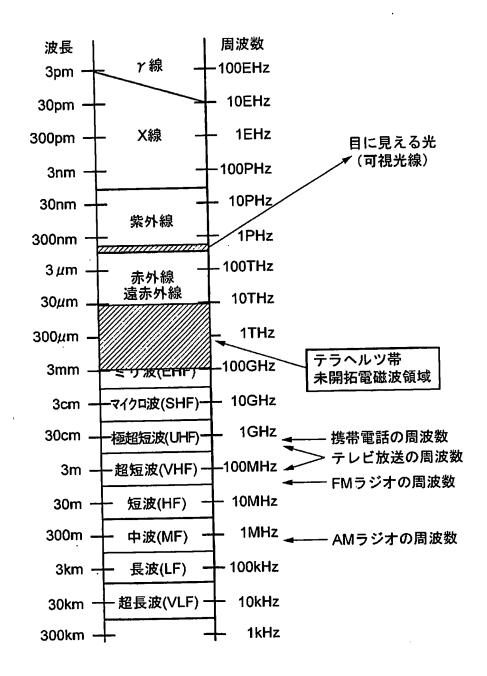
【図3】



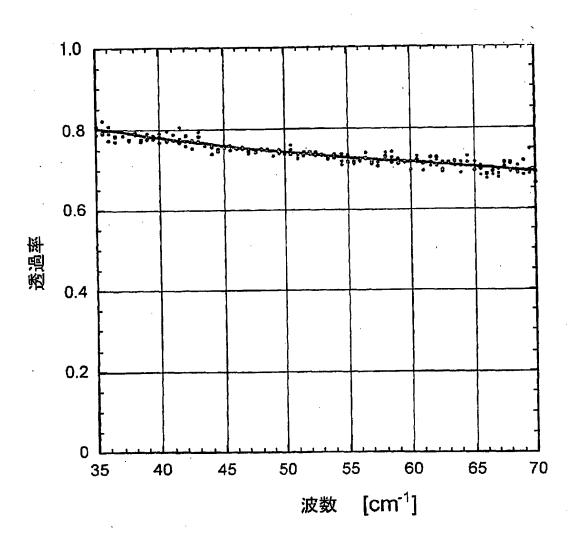
【図4】



【図5】



【図6】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 コストが低く、製造が簡単なテラヘルツ帯波の透過特性に優れたテラ ヘルツ帯波処理装置を得る。

【解決手段】 本テラヘルツ帯波処理装置は、所定のテラヘルツ波を発生するテラヘルツ波発生装置10と、発生されたテラヘルツ波の進行方向の前面に設けられた高機能樹脂により構成されたオプティクス光学面とを有している。より具体例として、オプティクス光学面として光半透過板4を構成する。テラヘルツ波発生装置10との間の光軸を第1の光透過規制器1で規制して光軸上のテラヘルツ波を透過させ、且つ所定の入射角度を有して入射される光を光半透過板4で反射させる。さらに、光半透過板4とSiボロメーターとの間の光軸上に第2の光透過規制器2、3が設定される。所定の可視光をパイロット光12として光半透過板4へ入射して、この光半透過板4により反射させ、該反射させた可視光の光軸をテラヘルツ波11の光軸へ重畳させる。この結果、テラヘルツ波11の光軸を可視光により模擬的に目視可能とする。

【選択図】 図3

【書類名】

出願人名義変更届(一般承継)

【提出日】

平成15年12月 1日

【あて先】

特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2003-107885

【承継人】

【識別番号】

503359821

【住所又は居所】 【氏名又は名称】 埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所

【承継人代理人】

【識別番号】

100075812

【弁理士】

【氏名又は名称】

吉武 賢次

【提出物件の目録】

【物件名】

権利の承継を証明する書面 1

【援用の表示】

平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

登記簿謄本 1 【物件名】

平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件 【援用の表示】

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

委任状 1 【物件名】

【物件名】

委任状

委 任 状



私は、

識別番号 100075812 弁理士 吉 武 賢 次 氏 を代理人と定めて下記事項を委任する。

95434

- 1. 別紙目録に配載の特許出願に関する出願人名義変更届をする件
- 2. 上記各項の手続を処理するため復代理人を選任及び解任する件

以上

平成 /5年 // 月 / 9日

住所又は居所

埼玉県和光市広沢2番1

氏名又は名称

独立行政法人 理化学研

代 表 者

理事長.野 依 良

目録(1)

1.	特顯昭63-235737	51.	特願平07-327372
2.	特願平05-044143	52.	特願平08-000652
3.	特願平05-127257	53.	特顯平08-026368
4.	特願平05-127258	54.	特願平08-030850
5.	特願平05-213675	55.	特願平08-041279
6.	特願平05-306164	56.	特願平08-045903
7.	特願平05-328611	57.	特願平08-051604
8.	特顧平05-336746	58.	特願平08-065715
9.	特願平06-035100	59.	特願平08-070071
10.	特願平08-061792	60.	特願平08-105667
11.	特願平06-061793	61.	特願平08-107784
12.	特顧平08-069150	62.	特願平08-116473
13.	特願平06-097098	63.	特願平08-123475
	特願平06-111624	64.	特願平08-127005
14.	特願平06-1211024	65.	特願平08-131746
15.		66.	特願平08-132846
16.	特願平06-145908	67.	特願平08-132854
17.	特願平06-158670	68.	特顯平08-142676
18.	特願平06-158671	69.	特願平08-158078
19.	特願平06-165751	70.	特願平08-167401
20.	特願平06-165752		特願平08-107401
21.	特願平06-181857	71.	17
22.	特願平06-235742	72.	特願平08-197050 特願平08-197051
23.	特願平06-238603	73.	
24.	特願平06-244764	74.	特願平08-211946
25.	特願平06-248486	75.	特願平08-216506
26.	特願平06-252942	76.	特顧平08-216508
27.	特願平06-268723	77.	特願平08-222352
28.	特願平06-293933	78.	特願平08-231066
29.	特願平06-301372	79.	特願平08-233442
30.	特願平06-323795	80.	特願平08-236685
31.	特願平06-324490	81.	特願平08-251410
32.	特願平06-507986(7級2002-		特願平08-262051
33.	特願平07-007185	83.	特願平08-302896
34.	特願平07-069255	84.	特顯平08-308335
35.	特願平07-082880	85.	特願平08-308336
36.	特願平07-083142	86.	特願平08-311467
37.	特願平07-117933	87.	特願平08-315093
38.	特願平07-133487	88.	特願平08-317622
39.	特顧平07-205141	89.	特願平08-320241
40.	特願平07-214659	90.	特願平0.8-506395
41.	特顯平07-217276	91.	特願平09-002295
42.	特願平07-236185	92.	特願平09-010602
43.	特願平07-240684	93.	特願平0.9-019968
44.	特願平07-249244	94.	特願平0:9-019969
45.	特願平07-259922	95.	特願平09-019971
46.	特願平07-282716	96.	特願平09-024890
47.	特顯平07-302793	97.	特願平09-028982
48.	特願平07-306004	98.	特願平09-046824
49.	特願平07-311711	99.	特願平09-049254
50.	特願平07-311715	100.	特願平09-053478

目録(2)

101.	特願平09-054595	151.	特願平10-045434
102.	特願平09-056654	152.	特願平10-049499
103.	特願平09-057342	153.	特願平10-049867
104.	特願平09-058774	154.	特願平10-051489
105.	特顧平09-067611	155.	特願平10-051490
106.	特願平09-074394		特願平10-051491
107.	特願平09-080480		特願平10-051492
108.	特願平09-082965		特願平10-051493
109.	特願平09-091523		特願平10-060740
110.	特願平09-091591		特願平10-060741
111.	特願平09-091694		特願平10-061895
112.	特顧平09-096968		特顧平10-076139
113.	特願平09-099061		特願平10-085207
114.	特願平09-099109		特願平10-085208
115.	特願平09-104093		特顧平10-103083
116.	特願平09-119730		特願平10-103115
117.	特顧平09-129068		特願平10-103671
118.	特願平09-134525		特願平10-104093
119.	特顧平09-147964		特願平10-113493
120.	特顧平09-155364		特願平10-116378
121.	特顯平09-159963		特願平10-121456
122.	特願平09-163630		特願平10-127520
123.	特願平09-163631	173.	特顯平10-136198
124.	特願平09-171924		特顧平10-149603
125.	特願平09-175896		特願平10-150494
126.	特願平09-180423		特顯平10-151245
127.	特願平09-189436	177.	特願平10-155838
128.	特願平09-198201	178.	特願平10-155841
129.	特願平09-208866	179.	特願平10-156104
130.	特願平09-221067	180.	特願平10-156108
131.	特願平09-228345	181.	特願平10-198313
132.	特顧平09-230870	182.	特願平10-200280
133.	特願平09-253740		特願平10-217132
134.	特願平09-256795		特願平10-217180
135.	特願平09-271782		特顯平10-222837
136.	特願平09-291995		特願平10-227939
137.	特願平09-297084		特顯平10-229591
138.	特願平09-307627		特願平10-232520
139.	特願平09-308597		特願平10-232590
140.	特願平09-309848		特顧平10-236009
141.	特顯平09-327140		特顯平10-237485
	特顯平09-327609		特願平10-238144
143.	特顧平09-328742		特願平10-245293
144.	特願平09-360327		特願平10-250598
145.	特顯平10-002030		特顯平10-250611
146.	特願平10-010471		特願平10-252128
147.	特願平10-014152	197.	特顧平10-260347
148.	特願平10-015690		特願平10-260416
149.	特願平10-024892	199.	特願平10-288791
150.	特願平10-043335	200.	特願平10-269859

目録(3)

201.	特願平10-272529	251. 特願平11-135137
202.	特願平10-280351	252. 特願平11-135482
203.	特願平10-30B533	253. 特願平11-143429
204.	特顯平10-309765	254。 特願平11-144005
205.	特願平10-311673	255. 特願平11-147097
206.	特願平10-311674	256. 特願平11-151099
	特願平10-311675	257. 特願平11-166247
207.		258. 特顧平11-173839
208.	特願平10-314856	259. 特願平11-179278
209.	特願平10-315751	
210.	特願平10-338896	
211.	特願平10-338897	281. 特願平11-193235
212.	特願平10-338898	262. 特願平11-224269
213.	特願平10-338899	263. 特願平11-225060
214.	特願平10-352428	264. 特願平11-225832
215.	特願平10-354665	265. 特願平11-225839
216.	特願平10-363297	266. 特願平11-226176
217.	特願平10-363329	267. 特顯平11-234800
218.	特願平10-506788	268. 特顯平11-240325
219.	特願平10-532832	269. 特願平11-240910
220.	特顯平10-535583	270. 特願平11-241737
221.	特顧平11-008183	271. 特願平11-242438
222.	特願平11-013380	272. 特顯平11-242490
223.	特願平11-015176	273. 特顯平11-253851
224.	特顧平11-031724	274. 特顧平11-260947
225.	特顯平11-035776	275. 特願平11-277759
226.	特顧平11-046372	276. 特顧平11-278976
227.	特願平11-055835	277. 特願平11-279324
228.	特願平11-055867	278. 特顯平11-281632
229.	特顯平11-055930	279. 特顯平11-303976
230.	特顯平11-056957	280. 特顧平11-309616
231.	特顧平11-057381	281. 特願平11-315036
232.	特顯平11-057749	282. 特願平11-321282
233.	特顯平11-058103	283. 特顧平11-336079
234.	特顧平11-061079	284. 特願平11-346467
235.	特願平11-061080	285. 特顧平11-354563
236.	特願平11-064193	286. 特願平11-360274
237.	特顯平11-064372	287. 特願平11-365899
238.	特願平11-064506	288. 特願平11-373483
239.	特顧平11-065136	289. 特顯平11-510791
		290. 特顯平11-515324
240.	特願平11-074335	291. 特願2000-001783
241.		292. 特顯2000-005221
242.	特顯平11-090383	293. 特願2000-009363
243.	特願平11-091875 特願平11-103231	294. 特顧2000-010516
244.		295. 特顧2000-010310
245.		
246.		
247.		
248.		298. 特顧2000-016622
249.		299. 特顧2000-017112
250.	特願平11-130815	300. 特顧2000-018612

目録(4)

301.	特願2000-019195	351. 特顧2000-141763
302.	特顯2000-019528	352. 特願2000-148843
303.	特願2000-020067	353. 特願2000-152455
304.	特願2000-030321	354. 特願2000-152469
	特願2000-034109	355. 特願2000-154484
305.		356. 特願2000-161895
306.	特願2000-039082	
307.	特願2000-040355	357. 特顧2000-163122
308.	特顧2000-041927	358. 特願2000-164584
309.	特願2000-041929	359. 特顧2000-179723
310.	特願2000-045318	360. 特願2000-181281
311.	特顧2000~045855	361. 特顧2000-184259
312.	特顧2000-051488	362. 特顧2000-184295
313.	特願2000-051650	363. 特願2000-191007
314.	特願2000-052040	364. 特願2000-191265
315.	特顧2000-053707	365. 特顧2000-192332
316.	特願2000-054949	366. 特顧2000-193817
317.	特願2000-056093	367. 特顧2000-195384
318.	特顧2000-056879	368. 特願2000-196991
319.	特願2000-057564	369. 特願2000-197022
320.	特願2000-057565	370. 特顯2000-202801
321.	特願2000-057566	371. 特願2000-216457
322.	特願2000-058133	372. 特願2000-223714
323.	特願 2 0 0 0 - 0 5 8 2 8 2	373. 特願2000-224970
324.	特願2000-062316	374. 特願2000-225486
324.	特願2000-062310	375. 特願2000-225864
326.	特願2000-064209	376. 特顧2000-225978
327.	特顯2000-071119	377. 特顯2000-226361
328.	特顯2000-076122	378. 特顧2000-229191
329.	特願2000-085874	379. 特顧2000-230551
330.	特願2000-089078	380. 特顧2000-237165
331.	特願2000-092693	381. 特顧2000-237166
332.	特願2000-100395	382. 特顧2000-237533
333.	特顧2000-105139	383. 特願2000-246309
334.	特願2000-105917	384. 特願2000-248331
335.	特顧2000-107160	385. 特願2000-249232
336.	特顧2000-108409	386. 特顧2000-256149
337.	特顧2000-109638	387. 特顧2000-257080
338.	特願2000-109954	388. 特願2000-257083
339.	特顧2000-118361	389. 特顧2000-260030
340.	特願2000-120874	390. 特顯2000-261233
341.	特願2000-123634	391. 特顯2000-264743
	特願2000-128431	392. 特顧2000-265344
342.	特額2000-131049	393. 特願2000-278502
343.	特願2000-131045	394. 特願2000-279557
344.		395. 特顧2000-292422
345.		396. 特願 2 0 0 0 - 2 9 2 8 3 2
346.	特願2000-134427	397. 特願2000-299812
347.	特願2000-136572	398. 特顧2000-307464
348.		399. 特顧2000-308248
349.		400. 特願2000-309581
350.	17 MQ Z U U U U I 4 I I U U U	TOO. TURNED OF GOOD I

目録(5)

	**************************************	451. 4	持願2001-071435
401.	特願2000-319775		持顧2001-072650
402.	特願2000-322056		時願2001-072668
403.	特願2000-333311		持顧2001-072963
404.	特願2000-334686		時願2001-072963 時願2001-073028
405.	特額2000-334969		
406.	特顧2000-343912		特願2001-074964 特願2001-074964
407.	特願2000-347398		持顧2001-074965
408.	特願2000-347865		特願2001-077257
409.	特願2000-358121		特顯2001-078671
410.	特願2000-368566		特願2001-084173
411.	特願2000-374626		特顯2001-089541
412.	特願2000-375090		特願2001-091911
413.	特願2000-378421		特顧2001-092337
414.	特願2000-378942	464.	特顧2001-116171
415.	特顧2000-378950		特顧2001-124294
416.	特願2000-384771		特願2001-124452
417.	特顧2000-387016		特願2001-127575
418.	特願2000-394815		特願2001-127576
419.	特願2000-396445		特願2001-135357
420.	特願2000-399940		特願2001-137087
421.	特願2000-400336		特願2001-138103
422.	特顧2000-401110		特願2001-142583
423.	特顧2000-401245		特願2001-147081
424.	特願2000-401258		特願2001-152364
425.	物願2000-503838		特顧2001-152379
426.	特顧2000-571733		特願2001-153447
427.	特願2000-571943		特願2001-155572
428.	特願2000-602588		特願2001-183740
429.	特願2000-602900		特顧2001-164819
430.	特願2000-618709		特願2001-164997
431.	特顧2001-003476	481.	特願2001-165133
432.	特顧2001-005615		特願2001-167910
433.	特顧2001-007979	483.	特願2001-168784
434.	特顧2001-016626		特顯2001-171705
435.	特顧2001-025030	485.	特願2001-173331
436.	特顧2001-037141	486.	特願2001-174421
437.	特願2001-037147	487.	特願2001-174553
438.	特願2001-042501	488.	特顧2001-175898
439.	特願2001-044933	489.	特願2001-178169
440.	特顧2001-047762	490.	特顧2001-179858
441.	特願2001-050645	491.	特顧2001-180552
442.	特願2001-053550	492.	特願2001-180554
443.	特願2001-054717	493.	特顧2001-187735
444.	特願2001-059115	494.	特願2001-197185
445.	特願2001-059892	495.	特顧2001-197897
446.	特願2001-060848	496.	特願2001-200854
447.	特願2001-062703	497.	特顧2001-201356
448.	特願2001-065799	498.	特願2001-202971
449.	特願2001-065917	499.	特願2001-203089
450.	特願2001-068285	500.	特願2001-206505

目録(6)

	***************************************	551. 特願2001-325367
501.	特願2001-206522	
502.	特願2001-206523	552. 特願2001-326872
503.	特願2001-209305	553. 特顯2001-327853
504.	特願2001-212947	554. 特願2001-329023
505.	特願2001-216505	555. 特願2001-332168
506.	特願2001-220219	556. 特顧2001-337467
507.	特願2001-226176	557. 特願2001-339396
508.	特願2001-228287	558. 特願2001-339593
509.	特願2001-228374	559. 特願2001-346035
510.	特顧2001-235412	560. 特願2001-347316
511.	特願2001-235747	561. 特願2001-347637
512.	特願2001-238951	562. 特願2001-349614
613.	特願2001-241023	563. 特願2001-351730
514.	特願2001-243930	564. 特願2001-352189
515.	特願2001-246642	565. 特願2001-353038
516.	特願2001-249976	566. 特願2001-358446
517.	特願2001-254377	567. 特顧2001-358581
518.	特願2001-254378	588. 特願2001-359710
519.	特顧2001-255589	569. 特願2001-374928
520.	特願2001-256576	570. 特願2001-376591
521.	特顧2001-257188	571. 特願2001-378757
522.	特願2001-261158	572. 特願2001-380473
523.	特願2001-266004	573. 特願2001-382537
524.	特願2001-266069	574. 特顧2001-382539
525.	特願2001-286454	575. 特願2001-382599
526.	特顧2001-267194	576. 特顧2001-385258
527.	特顧2001-267379	577. 特願2001-385512
528.	特願2001-267863	578. 特願2001-385513
529.	特願2001-272977	579. 特願2001-385538 580. 特願2001-388116
530.	特願2001-273964	
531.	特願2001-276053	
532.	特願2001-279406 特願2001-280319	582. 特願2001-392087 583. 特願2001-392088
533.	特願2001-285145	584. 特願2001-395196
534.	特願2001-291059	585. 特願2001-396120
535.	特願2001-291035	586. 特願2001-397762
536. 537.	特願2001-292223	587. 特顧2001-397998
538.	特願2001-292222	588. 特願2001-401139
539.	特顯2001-293054	589. 特顧2001-515803
540.	特願2001-293936	590. 特顧2.001-523852
541.	特願2001-294013	591. 特願2001-557672
	特顧2001-298140	592. 特顧2002-000993
	特願2001-298402	593. 特願2002-005746
543. 544.	特願2001-296402	594. 特願2002-010344
545.	特顧2001-309501	595. 特顯2002-011558
546.	特願2001-309508	596. 特顧2002-019752
540. 547.	特願2001-309984	597. 特顧2002-020329
547. 548.	特願2001-310554	598. 特顧2002-022499
	特願2001-310654	599. 特顧2002-028046
549.	特願2001-319360	600. 特願2002-028109
550.	DOCETE - ION SENDS	And Administration

目録(7)

	44	AFT
601.	特願2002-040151	651. 特願2002-162157
602.	特願2002-042829	652. 特願2002-162211
603.	特願2002-044340	653. 特顧2002-162365
604.	特願2002-044640	654. 特願2002-167759
605.	特願2002-046188	655. 特願2002-170068
606.	特願2002-047799	656. 特願2002-170902
607.	特願2002-053190	657. 特願2002-176435
608.	特願2002-053575	658. 特願2002-176583
609.	特願2002-055272	659. 特顯2002-183722
610.	特願2002-057253	680. 特願2002-185966
611.	特願2002-057565	661. 特願2002-187362
612.	特願2002-057935	662. 特願2002-187957
613.	特願2002-057963	663. 特顯2002-188281
614.	特願2002-066249	664. 特願2002-189265
615.	特顧2002-070624	665. 特顯2002-194627
616.	特願2002-070987	666. 特願2002-197812
617.	特顧2002-070907	667. 特願2002-201443
	特顧2002-071924	668. 特顧2002-201575
618.	特願2002-074902	669. 特願2002-201373
619.		670. 特顧2002-202116
620.	特願2002-081467 特願2002-081502	671. 特願2002-205814
621.		672. 特願2002-205825
622.	特願2002-083081	673. 特顧2002-217714
623.	特願2002-084139	674. 特願2002-221166
624.	特願 2 0 0 2 - 0 8 5 0 1 7	
625.	特願2002-087342	675. 特願2002-225724
626.	特願2002-094681	876. 特願2002-226859
627.	特願2002-095132	677. 特願2002-227286
628.	特願2002-095389	678. 特願2002-229686
629.	特願2002-100431	679. 特願2002-230562
630.	特願2002-106561	680. 特願2002-235294
631.	特願2002-119320	681. 特願2002-235737
632.	特顯2002-120371	682. 特願2002-236838
633.	特願2002-123347	683. 特顧2002-237058
634.	特願2002-128854	684. 特願2002-237092 685. 特願2002-248946
635.	特願2002-133717	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
636.	特願2002-133749	686. 特願2002-253322
637.	特顧2002-134313	687. 特顧2002-253689
638.	特顧2002-141187	688. 特顧2002-253697
639.	特願2002-141438	689. 特顧2002-254096
640.	特願2002-142260	690、特願2002-257924
641.	特願2002-149471	691. 特顧2002-260788
642.	特願2002-149931	692. 特願2002-261499
643.	特願2002-150541	693. 特顧2002-264969
644.	特願2002-154688	694. 特願2002-267114
в45.	特願2002-154695	695. 特願2002-268987
646.	特願2002-154823	696. 特願2002-270917
647.	特願2002-158237	697. 特願2002-271375
648.	特願2002-158352	698. 特願2002-271473
649.	特願2002-160277	699. 特願2002-273996
650.	特願2002-162148	700. 特顯2002-274469

目録(8)

701.	特願2002-276051	751. 特願2003-012738
702.	特願2002-282746	752、 特願2003-012774
703.	特顧2002-286487	753、 特願2003-015968
704.	特願2002-289209	754. 特願2003-016044
705.	特願2002-295332	755、 特願2003-016940
706.	特願2002-296911	756. 特願2003-017397
707.	特願2002-2994,29	757。 特顯2003-021499
708.	特願2002-301875	758. 特願2003-024347
709.	特願2002-303838	759. 特願2003-024620
710.	特願2002-312131	760. 特願2003-025277
711.	特顧2002-320102	761. 特願2003-027647
712.	特顧2002-320704	762. 特願2003-027648
713.	特願2002-325909	763. 特願2003-031882
714.	特願2002-325920	764. 特顧2003-032932
715.	特願2002-332232	765. 特願2003-038206
716.	特願2002-339344	766. 特願2003-040642
717.	特顧2002-339392	767. 特願2003-043961
718.	特願2002-339541	768、特願2003-050153
719.	特願2002-339551	769. 特願2003-050446
720.	特願2002-341195	770. 特願2003-052520
721.	特願2002-343807	771. 特願2003-052602
722.	特顧2002-344279	772. 特願2003-052613
723.	特願2002-345597	773. 特願2003-052877
724.	特願2002-347401	774. 特願2003-053023
725.	特願2002-348760	775、 特顧2003-054182
726.	特顧2002-349042	776. 特願2003-054798
727.	特願2002-354594	777. 特願2003-054799
728.	特額2002-357768	778. 特顧2003-054846
729.	特願2002-357900	779. 特願2003-054847
730.	特願2002-358019	780. 特顧2003-054848
731.	特願2002-358967	781. 特顧2003-054849
732.	特願2002-360972	782. 特顧2003-055452
733.	特願2002-360975	783. 特願2003-056628
734.	特願2002-368112	784. 特願2003-061426
735.	特願2002-376555	785. 特願2003-063532
736.	特顧2002-376774	786. 特願2003-065013
737.	特顧2002~376831	787. 特顧2003-071028
738.	特顧2002~379214	788. 特顧2003-072979
739.	特顧2002-380624	789. 特顧2003-074168
740.	特願2002-381888	790. 特顯2003-076107
741.	特願2002-382170	791. 特顧2003-078999
742.	特願2002-383870	792. 特顯2003-079598
743.	特願2002-521644	793. 特顧2003-079613
744.	特願2002-532458	794. 特願2.0-03-082466
745.	特願2002-546564	795. 特顯2003-083318
746.	特願2002-548185	796. 特顧2003-083433
747.	特願2002-570743	797. 特顧2003-083480
748.	特願2003-003450	798. 特願2003-085193
749.	特願2003-012550	799. 特願2003-089026
750.	特願2003-012694	800. 特願2003-090331

目録(9)

	41	074 SAMO 0 0 0 1 0 7 1 0 E
801.	特願2003-091446	851. 特額2003-127135
802.	特願2003-092654	862. 特願2003-127150
803.	特願2003-093642	853. 特顧2003-128818
804.	特願2003-094272	854. 特顧2003-128897
805.	特願2003-094719	855. 特願2003-129347
806.	特顧2003-095770	856. 特願2003-131313
807.	特願2003-095884	857. 特顧2003-132280
80B.	特願2003-095885	858. 特顧2003-132605
809.	特願2003-095886	859. 特願2003-132606
810.	特願2003-095904	860. 特顧2003-135591
811.	特願2003-097283	861. 特願2003-136445
812.	特顧2003-097327	862. 特願2003-139397
813.	特願2003-101917	863. 特願2003-140684
	特願2003-101017	864. 特願2003-142303
814.	特願2003-104320	865. 特顧 2 0 0 3 - 1 4 3 9 3 2
815.		866. 特顧2003-145221
816.	特願2003-107267	
817.	特願2003-107268	887. 特顧2003-145390 868. 特顧2003-147820
818.	特願2003-107647	
819.	特願2003-107885	889. 特願2003-150690
820.	特願2003-109575	870. 特願2003-153014
821.	特顧2003-115750	871. 特願2003-153015
822.	特願2003-115793	872. 特願2003-153016
823.	特顧2003-115847	873. 特願2003-15.3985
824.	特顯2003-115888	874. 特願2003-154009
825.	特顧2003-116232	875. 特願2003-154841
826.	特顧2003-116895	876、特顧2003-155397
827.	特願2003-118161	877. 特顯2003-155407
828.	特願2003-118186	878. 特顧2003-158017
829.	特顧2003-119749	879. 特顧2003-161005
830.	物願2003-119930	880. 特顧2003-164126
831.	特願2003-120934	881. 特願2003-170051
832.	特願2003-121233	882. 特顧2003-170324
833.	特願2003-121261	883. 特願2003-170325
834.	特願2003-121273	884. 特願2003-170326
835.	特願2003-121780	885. 特願2003-170327
836.	特顧2003-122245	886. 特願2003-170328
837.	特願2003-123984	887. 特顯2003-170329
838.	特顯2003~124654	888. 特願2003-170330
839.	特願2003-124655	889. 特顧2003-170573
840.	特願2003-124826	890. 特願2003-171576
841.	特願2003-124829	891. 特顧2003-171619
842.	特願2003-124833	892. 特顧2003-172898
843.	特顧2003-124835	893. 特願 2 0 0 3 - 1 7 5 8 1 9
844.		894. 特願2003-177298
845.	特顧2003-125403	895. 特願2003-180198
846.	特願2003-125405	896. 特願2003-182958
847.	特願2003-127090	897. 特顧2003-192763
848.	特願2003-127093	898. 特願2003-192775
849.	特願2003-127093	899. 特願2003-194837
850.	特願2003-127105	900. 特願2003-197229
DOU.	10 10 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0	DON TORNES OF TO 1225

目録(10)

```
901.
   特願2003-198340
   特願2003-204075
902.
903.
   特顧2003-205349
   特願2003-205710
904.
   特願2003-206546
905.
   特願2003-207698
906.
907.
   特顧2003-207771
   特願2003-207772
908.
   特願2003-207850
909.
   特顯2003-270049
910.
911.
   特願2003-271473
912.
   特願2003-272421
   特願2003-275055
913.
   特顧2003-277958
914.
   特顧2003-279130
915.
916.
   特顧2003-283972
917.
   特顧2003-284055
918.
   特顧2003-286640
   特顧2003-289138
919.
920.
   特願2003-293912
   特顧2003-296474
921.
   特願2003-298558
922.
   特願2003-299424
923.
   特願2003-303979
924.
925.
   特願2003-304452
   特願2003-304453
926.
   特願2003-305689
927.
928.
   特願2003-305844
   特顧2003-306137
929.
930.
   特額2003-307564
931.
   特願2003-313014
932.
   特顧2003-315355
   特願2003-318801
933.
   特顧2003-321497
934.
   特願2003-322948
935.
936.
   特願2003-324974
   特願2003-326510
937.
   特願2003-327645
938.
   特願2003-327907
939.
   特願2003-328600
940.
   特願2003-328840
941.
942.
   特願2003-330418
943.
   特願2003-330569
   特願2003-331848
944.
945.
   特願2003-332756
946.
   特願2003-333798
947.
   特顯2003-333932
   特願2003-334036
948.
949. 特願2003-334083
   特願2003-336365
950.
```

951. 特願2003-338191 952. 特願2003-339542 953. 特願2003-340181 954. 特願2003-342519 特願2003-107885

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-107885

受付番号

20308550812

鲁類名

出願人名義変更届(一般承継)

担当官

小松 清

1905

作成日

平成16年 3月26日

<認定情報・付加情報> 【提出された物件の記事】

【提出物件名】

委任状(代理権を証明する書面) 1

特願2003-107885

出願人履歴情報

識別番号

[000006792]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

1990年 8月28日 新規登録 埼玉県和光市広沢2番1号

氏 名

特願2003-107885

出願人履歴情報

識別番号

[503137322]

1. 変更年月日

2003年 4月11日

[変更理由]

新規登録

住 所

宮城県仙台市青葉区南吉成六丁目6番地の3

氏 名 有限会社パックス

ページ: 3/E

特願2003-107885

出願人履歴情報

識別番号

[503359821]

1. 変更年月日 [変更理由]

2003年10月 1日 新規登録

住所氏名

埼玉県和光市広沢2番1号

独立行政法人理化学研究所